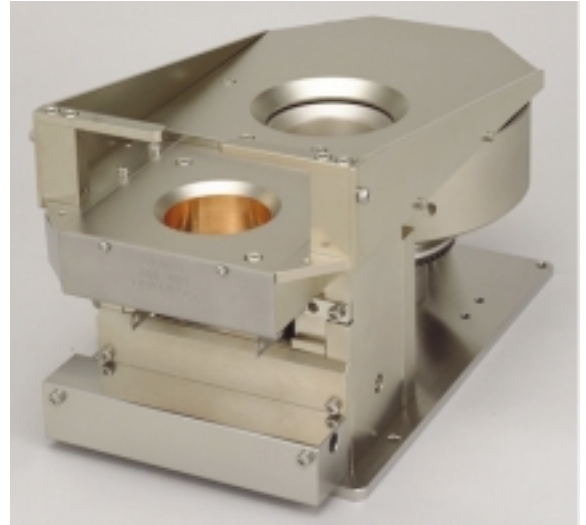


# 電子ビーム蒸着源

## 概要

電子ビーム蒸着源は蒸着材料を入れるルツボと電子ビーム発生機構及び電子ビームの偏向磁極などから構成されています。フィラメントで発生した熱電子は-10kVの電圧（可変）で加速され磁場により偏向された後、ルツボ内の蒸着材料に当てられ、蒸着材料を加熱蒸発させます。



## 特徴

高融点金属から酸化物、化合物、昇華性物質などさまざまな材料を加熱蒸発可能

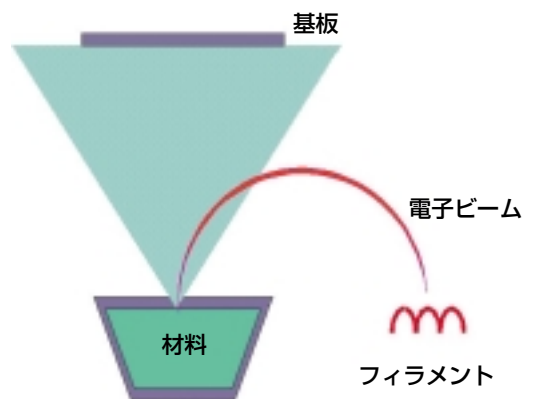
スパッタなどと比較して成膜速度が速く厚膜成膜が可能

多層膜の成膜が可能

膜厚モニタにより所定の膜厚にコントロール可能

ルツボ全体を水冷にすることにより、ルツボと蒸着材料との溶着を防ぐ構造

## 原理図



電子ビームを偏向、集束して材料上に照射し加熱蒸発させる